

カスタムメイド万能Cvd管状炉化学蒸着Cvd装置マシン

商品番号: KT-CTF16



前書き

KINTEKのCVD管状炉は、薄膜蒸着に理想的な1600℃までの精密温度制御を提供します。研究および工業のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。

[詳細を学ぶ](#)

炉型	KT-CTF16-60
最高温度	1600℃
一定作業温度	1550℃
炉管材質	高純度Al ₂ O ₃ 管
炉管の直径	60mm
加熱ゾーン	3x300mm
チャンバー材質	アルミナ多結晶ファイバー
発熱体	炭化ケイ素
加熱速度	0~10℃/分
熱電対	Sタイプ
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー
温度制御の正確さ	±1℃
ガス精密制御ユニット	
流量計	MFCマスフローメーター
ガスチャンネル	3チャンネル（カスタマイズ可能）
流量（例）	MFC1: 0-5SCCM O ₂ MFC2: 0-20SCCM CH ₄ MFC3: 0~100SCCM H ₂ MFC4: 0~500SCCM N ₂ （カスタマイズ可能）
直線性	±0.5% F.S.
繰り返し性	±0.2% F.S.
配管およびバルブ	ステンレス鋼
最高使用圧力	0.45MPa
流量計コントローラー	デジタルノブコントローラー/タッチスクリーンコントローラー

標準真空ユニット（オプション）

真空ポンプ	ロータリーベーン真空ポンプ
ポンプ流量	4L/S
真空吸引ポート	KF25
真空計	ピラニ/抵抗シリコン真空計
定格真空圧	10Pa

高真空ユニット（オプション）

真空ポンプ	ロータリーベーンポンプ+分子ポンプ
ポンプ流量	4L/S+110L/S
真空吸引ポート	KF25
真空計	複合真空計
定格真空圧	6x10 ⁻⁵ Pa

上記仕様およびセットアップはカスタマイズ可能です。

No.	内容	数量
1	温度制御付き炉本体	1
2	高純度アルミナまたは石英管（注文による）	1
3	ポート付き真空シールフランジ	2セット
4	チューブサーマルブロック/プラグ	2
5	チューブサーマルブロックフック	1
6	耐熱グローブ	1組
7	精密ガス制御ユニット（注文に応じてMFC）	1セット
8	真空ユニット（ポンプとゲージは注文による）	1セット
9	取扱説明書	1